# 財團法人工業技術研究院　函

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：劉珈瑛
電話：03-5917469
傳真：03-5820466
E-mail：itri533591@itri.org.tw

108000683508

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 108. 04. 26 文
檔號: 108255

241 三重區重新路五段 609 巷 6 號 3 樓之 3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
發文日期：中華民國 108 年 04 月 25 日
發文字號：工研轉字第 1080006835 號
速別：普通件
密等：無
附件：如文

主旨：有關本院「光學檢測相關專利非專屬授權案」，敬請轉知貴會會員等相關廠商重要資訊，把握機會參與本活動，請 查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智財防護能力，本院將辦理光學檢測相關專利(5 案 9 件)之非專屬授權活動(詳如附件)。

二、有關本活動詳細資訊，請參考下列網站公告：

（一）工研院研發成果公告網站（https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1）

（二）台灣技術交易資訊網（https://www.twtm.com.tw/Web/news/trans.aspx）。

三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

四、公開說明會：

（一）舉辦時間：民國（下同）108 年 5 月 10 日下午 15 時至 16 時。

（二）舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。

（三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 5 月 9 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「光學檢測相關專利非專屬授權案」公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。

五、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 劉小姐

電話：(03)591-7469

傳真：(03)582-0466

電子信箱：itri533591@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

院長 劉文雄

依權責劃分規定授權業務主管決行

# 財團法人工業技術研究院

# 光學檢測相關專利非專屬授權案

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、非專屬授權標的：光學檢測相關專利 5 案 9 件，詳如下述網站:

（一）工研院研發成果公告網 ：

https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1

（二）台灣技術交易資訊網(TWTM) ：

https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx

三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

四、公開說明會：

（一）舉辦時間：民國（下同）108 年 5 月 10 日下午 15 時至 16 時。

（二）舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。

（三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 5 月 9 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「光學檢測相關專利非專屬授權案公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）。

五、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 劉小姐

電話：(03) 591-7469

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：itri533591@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

# 附件：授權標的清單 (5 案 9 件)

| 技術類別 | 案次 | 案編號 | 件次 | 件編號 | 專利名稱 | 國家 | 狀態 | 申請號 | 專利證號 | 獨有共有 | 專利起期 | 專利迄期 | 委辦單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光學檢測(5 案 9 件) | 1 | P07950015 | 1 | P07950015TW | 表面電漿共振檢測裝置及檢測方法 | TW | 獲證 | 95149149 | I322887 | 獨有 | 20100401 | 20261226 | 經濟部技術處 |
| | | | 2 | P07950015US | | US | 獲證 | 11/760,356 | 7,663,758 | 獨有 | 20100216 | 20280719 | 經濟部技術處 |
| | 2 | P07960005 | 3 | P07960005CN | 多通道光譜量測裝置與相位差解析方法 | CN | 獲證 | 200710188707.X | ZL200710188707.X | 獨有 | 20101229 | 20271114 | 經濟部技術處 |
| | | | 4 | P07960005TW | | TW | 獲證 | 96136839 | I340237 | 獨有 | 20110411 | 20271001 | 經濟部技術處 |
| | 3 | P07960024 | 5 | P07960024CN | 光學式非球面測量系統及其平台 | CN | 獲證 | 200710152071.3 | ZL200710152071.3 | 獨有 | 20110126 | 20271008 | 經濟部技術處 |
| | | | 6 | P07960024TW | 光學式非球面量測系統及其平台 | TW | 獲證 | 96137645 | I340234 | 獨有 | 20110411 | 20271007 | 經濟部技術處 |
| | 4 | P07970031 | 7 | P07970031TW | 雙面光學片滾壓對位量測系統及其方法 | TW | 獲證 | 97147100 | I381255 | 獨有 | 20130101 | 20281203 | 經濟部技術處 |
| | | | 8 | P07970031US | | US | 獲證 | 12/571,961 | 8,223,335 | 獨有 | 20120717 | 20301217 | 經濟部技術處 |
| | 5 | P07980022 | 9 | P07980022TW | 雙面光學膜片量測裝置與方法 | TW | 獲證 | 98143293 | I408331 | 獨有 | 20130911 | 20291216 | 經濟部技術處 |

※本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利申請範圍內之延續案、分割案、EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。